

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】令和4年12月13日(2022.12.13)

【公開番号】特開2022-54974(P2022-54974A)

【公開日】令和4年4月7日(2022.4.7)

【年通号数】公開公報(特許)2022-062

【出願番号】特願2020-162284(P2020-162284)

【国際特許分類】

G 01 N 23/20025(2018.01)

10

H 01 M 10/48(2006.01)

H 01 M 10/052(2010.01)

H 01 M 10/0562(2010.01)

H 01 M 10/0585(2010.01)

【F I】

G 01 N 23/20025

H 01 M 10/48 A

H 01 M 10/052

H 01 M 10/0562

H 01 M 10/0585

20

【手続補正書】

【提出日】令和4年11月30日(2022.11.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項6】

一方の端面が前記試料室に配置した試料の一端面に接触し、かつ他方の端面が前記圧受け部に接触する圧受け部材を、前記試料室内に有することを特徴とする請求項5に記載の加圧分析用構造体。

30

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

ここで、一方の端面が試料室に配置した試料の一端面に接触し、かつ他方の端面が圧受け部に接触する圧受け部材を、試料室内に有する構成とすることが好ましい。これにより、試料の外面をX線窓と対して露出させ、当該試料の外面にX線を照射することが可能となる。

40